

公開番号 又は 特許番号	WO2012-008577、再表 2012-008577
発明名称	基体、及び該基体の製造方法
出願人 又は 権利者	株式会社フジクラ、国立大学法人東京大学
想定デバイス	バイオ分析チップ、その他
要約	<p><b>【利用分野】</b> 微細孔の製造方法および微細孔を有する基体に関するもの。</p> <p><b>【発明の内容】</b> 微細孔の開口部を、レーザー光の照射およびエッチングによる加工限界よりも、さらに小さく加工することを可能とする微細孔の製造方法、および前記製造方法により製造される微細孔を有する基体を提供するものであり、前記基体は、微生物又は細胞（T）を補足するための基体（10A）である。基材（4）と、微生物又は細胞を含む流体（R）を流入させる空間（2）と、前記空間と前記基材の外部とを連通する微小吸引孔と、を含み、前記空間は前記基材内に設けられ、前記基材の内、少なくとも前記微小吸引孔を構成する部位は、単一の部材で構成されることを特徴とする、微生物又は細胞を補足するための基体。</p>
図面	